

平成 23 年度装置開発技術系活動報告

千田進幸

工学系技術支援室 装置開発技術系

1. はじめに

装置開発技術系は昨年度末に 1 名が退職し、4 月 1 日付で 1 名が技術部本部付けとなった。従って当技術系の本年度の人員構成は、課長 1 名、課長補佐（班長兼任）1 名、第 1 技術班 4 名（班長 1 名、班員 3 名）、第 2 技術班 6 名（班長 1 名、班員 5 名）、第 3 技術班 7 名（班長 1 名、班員 6 名）、第 4 技術班 5 名（班長 1 名、班員 4 名）であり、総勢 23 名である。

2. 装置開発技術系の実施業務

装置開発技術系は、短期・長期業務依頼による研究者・学生の独創的なアイデアに基づき、教育・研究に必要な機械装置の設計・試作、電子回路装置の製作、およびガラス製装置の製作を行っている。また、創造工学センターものづくり公開講座等の教育支援（本技報参照）各学科・専攻の安全教育や工作実習支援業務、シンクロトロン光研究センターの支援業務、および平成 22 年度より始められたマイクロ・ナノ加工を支援する業務等を実施している。

3. 系の運営に関わる業務

3.1 系業務調整会議

系の運営について協議する会議であり、課長、課長補佐、班長の 5 名で構成されている。本年度は原則的に毎週火曜日、始業時より 1 時間程度開催している。主な議題は技術部調整連絡会議の報告、班会議の報告、および技術系内の検討事項について協議している。尚、毎回の議事録は班長が輪番で書記を務め、次週の会議の冒頭で読み合わせを行い、内容の承認を取っている。

3.2 系専門委員会

系内の業務の執行状況や運営に関わる諸問題などを協議する委員会であり、教員 4 名、技術職員 5 名（班長以上）で構成されている。本年度の会議の概要は次のようであった。

第 1 回

日時：平成 23 年 7 月 12 日（火）13:00～14:00

場所：ES 総合館小会議室（ES 館 3 階）

- 議題：1. 系専門委員会の構成
2. 系経費の決算・予算
3. 活動計画
4. 技術部支援経費の使途
5. その他

4．系に関わる研修等

4.1 研修

本年度の装置開発技術系に関わった研修課題は次のようであった。

(1)技術系研修

「授業「材料加工学」補完実習の実験技術の改善」

皆川 清、中木村雅史、福森 勉、千田進幸

(2)個別研修

「CNC 旋盤の技術習得」

後藤伸太郎

「ガラス工作講習会の計画・立案と実施」

川崎竜馬、森木義隆

尚、内容の詳細は本技報に掲載されている。参照して頂きたい。

4.2 講習会

本年度は8月23日（火）および8月30日（火）に次のような概要で講習会を開催した。

・テーマ：3D・CAD Inventor の基本操作について

・講師：立花一志、中木村雅史、後藤伸太郎

尚、本講習会の詳細は、本技報に掲載されている。参照して頂きたい。